

社会人向け人材育成 スケジュール (予定)

市営バス 行き：青葉山駅 (9:26) →青葉台 (9:37) 青葉台バス停から西澤センターまで徒歩～10分
 帰り：青葉台 (17:17) →青葉山駅 (17:28)、青葉台 (18:17) →青葉山駅 (18:28)

1日目

Group A 6人

~9:50		集合 (西澤潤一記念研究センター2階 MEMSショールーム)
10:00		クリーンルーム入室準備
10:15		シランカップリング材 (HMDS) 塗布 (スピコータ)
		レジスト塗布 (スピコータ)
		露光 (コンタクトアライナ)
		現像 (現像ドラフト)
		パターン確認 (顕微鏡)
	11:30	ベーク (ホットプレート)
11:30	12:30	B+イオン注入
12:30	13:15	昼食
13:15	13:40	レジスト表面除去 (O ₂ プラズマアッシング)
13:40	14:10	レジスト除去 (硫酸+過酸化水素)
14:10	14:30	活性化熱処理 (Rapid thermal annealing)
14:30	14:40	自然酸化膜除去 (フッ酸)
15:00		Alスパッタ
15:30	17:00	座学
17:05		終了

Group B 7人

~9:50		集合 (西澤潤一記念研究センター2階 MEMSショールーム)
10:00		クリーンルーム入室準備
10:10	11:40	座学
11:40	12:25	昼食
12:30		シランカップリング材 (HMDS) 塗布 (スピコータ)
		レジスト塗布 (スピコータ)
		露光 (コンタクトアライナ)
		現像 (現像ドラフト)
		パターン確認 (顕微鏡)
	13:45	ベーク (ホットプレート)
13:45	14:45	B+イオン注入
14:45	15:15	レジスト表面除去 (O ₂ プラズマアッシング)
15:15	15:45	レジスト除去 (硫酸+過酸化水素)
15:45	16:15	活性化熱処理 (Rapid thermal annealing)
16:15	16:25	自然酸化膜除去 (フッ酸)
16:30		Alスパッタ
17:05		終了

2日目

Group A 6人

~9:50		集合 (西澤潤一記念研究センター2階 MEMSショールーム)
10:05		クリーンルーム入室準備
10:15		シランカップリング材 (HMDS) 塗布 (スピコータ)
		レジスト塗布 (スピコータ)
		露光 (コンタクトアライナ)
		現像 (現像ドラフト)
		パターン確認 (顕微鏡)
	11:30	ベーク (ホットプレート)
11:30	12:00	Alウェットエッチング
12:00	12:30	レジスト除去 (有機溶剤)
12:30	13:30	熱処理 (シンタリング)、昼食
13:30	15:00	抵抗測定
15:00	15:20	休憩
15:20	16:50	装置見学
17:05		終了

Group B 7人

~9:50		集合 (西澤潤一記念研究センター2階 MEMSショールーム)
10:00		クリーンルーム入室準備
10:10	11:40	装置見学
11:40	12:40	昼食
12:40		シランカップリング材 (HMDS) 塗布 (スピコータ)
		レジスト塗布 (スピコータ)
		露光 (コンタクトアライナ)
		現像 (現像ドラフト)
		パターン確認 (顕微鏡)
	14:00	ベーク (ホットプレート)
14:00	14:30	Alウェットエッチング
14:30	15:00	レジスト除去 (有機溶剤)
15:00	16:00	熱処理 (シンタリング)、休憩
16:00	16:55	抵抗測定
17:05		終了